

Patent  
Attorney Docket No. 007413-067

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of

Michael STEIGERWALD

Application No.: 10/670,556

Filing Date: September 26, 2003

Group Art Unit: 2833

Examiner: Unassigned

Confirmation No.: 8121

Title: ELECTRON BEAM SOURCE, ELECTRON  
OPTICAL APPARATUS USING SUCH BEAM  
SOURCE AND METHOD OF OPERATING  
AN ELECTRON BEAM SOURCE

**SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following priority foreign application(s) in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed.

Country: Germany

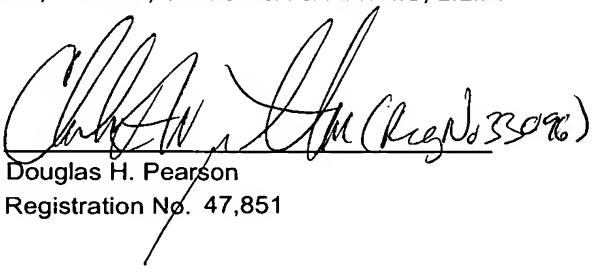
Patent Application No(s).: 102 45 052.8

Filed: September 26, 2002

In support of this claim, enclosed is a certified copy(ies) of said foreign application(s). Said prior foreign application(s) is referred to in the oath or declaration. Acknowledgment of receipt of the certified copy(ies) is requested.

Respectfully submitted,

BURNS, DOANE, SWECKER & MATHIS, L.L.P.

By   
for Douglas H. Pearson  
Registration No. 47,851

P.O. Box 1404  
Alexandria, Virginia 22313-1404  
(703) 836-6620

Date: February 5, 2004

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 102 45 052.8

**Anmeldetag:** 26. September 2002

**Anmelder/Inhaber:** LEO Elektronenmikroskopie GmbH, Oberkochen/DE

**Bezeichnung:** Elektronenstrahlquelle und elektronenoptischer Apparat mit einer solchen

**IPC:** H 01 J 37/075

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 15. Juli 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of the President of the German Patent and Trademark Office. The signature is fluid and cursive, with several loops and variations in line thickness.

Agurks

**DIEHL · GLAESER  
HILTL & PARTNER**

GESELLSCHAFT BÜRGERLICHEN RECHTS

Patentanwälte · Augustenstrasse 46 · D - 80333 München

Dr. Hermann O. Th. Diehl · Diplom-Physiker  
Joachim W. Glaeser · Diplom-Ingenieur  
Dr. Elmar Hiltl · Diplom-Chemiker  
Dr. Frank Schorr · Diplom-Physiker  
Dr. Christian Huber · Diplom-Chemiker  
Dr. Klaus Hinkelmann · Diplom-Chemiker  
In Kooperation mit Diehl & Partner AG  
CH - 7513 Silvaplana · Schweiz

Patentanwälte · European Patent Attorneys  
München · Hamburg

26. September 2002

Z8966-DE FS/HQ/NS

Anmelder: LEO Elektronenmikroskopie GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 56  
73447 Oberkochen  
Deutschland

**Elektronenstrahlquelle und  
elektronenoptischer Apparat mit einer  
solchen**

Kanzlei · Office: München

Telefon · Telephone  
(089) 17 86 36-0

Telefax · Facsimile  
(089) 1 78 40 33  
(089) 1 78 40 34

E-mail/Internet  
[info@diehl.ccn.de](mailto:info@diehl.ccn.de)  
[www.diehl-patent.de](http://www.diehl-patent.de)

Anschrift · Address  
Augustenstrasse 46  
D - 80333 München

Postanschrift · Mailing address  
P.O. Box 34 0115  
D - 80098 München

5

**Elektronenstrahlquelle und  
elektronenoptischer Apparat mit einer solchen**

---

10 Die Erfindung betrifft eine Elektronenstrahlquelle und  
einen elektronenoptischen Apparat mit einer solchen Elek-  
tronenstrahlquelle.

15 Elektronenoptische Apparate, wie beispielsweise Elek-  
tronenmikroskope oder Lithographievorrichtungen, welche  
Elektronen zur Abbildung eines Musters auf einem Substrat  
einsetzen, umfassen wenigstens eine Elektronenstrahl-  
quelle, um einen Elektronenstrahl bereitzustellen, wel-  
cher in dem Apparat für eine elektronenoptische Abbildung  
20 oder andere Zwecke eingesetzt wird.

25 Typische Anforderungen an eine Elektronenstrahlquelle  
sind die Bereitstellung eines Elektronenstrahls mit hohem  
Strahlstrom oder/und mit hoher Brillanz ("brightness")  
oder/und mit guter zeitlicher Konstanz der Intensität  
oder/und mit einer kleinen Breite (FWHM, "full width at  
half maximum") der Verteilung der kinetischen Energie der  
Elektronen in dem bereitgestellten Elektronenstrahl.

30 Eine typische Elektronenstrahlquelle umfasst einen Ka-  
thodenkörper mit einer Quelloberfläche, von der die Elek-  
tronen emittiert werden, und einer mit Abstand von der  
Quelloberfläche angeordnete Anode zur Bereitstellung  
eines elektrischen Extraktionsfeldes, um die Emission der  
35 Elektronen zu unterstützen. Es kann auch eine Heizein-

richtung vorgesehen sein, um die Quelloberfläche zu heizen und hierdurch die Emission der Elektronen ebenfalls zu unterstützen.

5 Je nach Stärke des Extraktionsfeldes bzw. der Höhe der Temperatur der Quelloberfläche werden verschiedene physikalische Prozesse unterschieden, welche die Emission der Elektronen von der Oberfläche hervorrufen (siehe z.B. Reimer, Scanning Electron Microscopy: Physics of Image 10 Formation and Microanalysis, 2<sup>nd</sup> edition, Springer series in optical sciences, 1998). Um sich von der Oberfläche zu entfernen, muss das Elektron eine Potentialbarriere überwinden, welche als Arbeitsfunktion bzw. work function  $\phi_w$  oder als chemisches Potential  $\mu_e$  bezeichnet wird.

15 Ist die Temperatur der Quelloberfläche so hoch, dass Elektronen die Potentialbarriere vom Fermi-Niveau  $E_F$  des Kathodenmaterials durch thermische Anregung überwinden können, so spricht man von einem thermischen Emissions-20 prozess. Solche Bedingungen werden beispielsweise bei einer Wolfram-Kathode bei einer Temperatur des Kathodenmaterials von 2500 K bis 3000 K erreicht.

Bei niedrigen Temperaturen der Quelloberfläche derart, 25 dass thermische Anregungsprozesse zur Emission der Elektronen eine geringe Rolle spielen, und ein starkes elektrisches Extraktionsfeld angelegt ist, dominiert ein Feldemissionsprozess, und im wesentlichen nach diesem Prinzip arbeitende Quellen werden als Feldemissions-30 quellen bezeichnet. Hierzu notwendige elektrische Feldstärken liegen in der Regel bei über  $10^7$  V/cm. Eine Erklärung für diesen Prozess ist derart, dass das starke elektrische Feld wohl auch zu einer gewissen Absenkung

der Potentialbarriere führt, diese durch die Feldwirkung so schmal wird, dass sie von den emittierten Elektronen durch einen Tunneleffekt überwunden werden kann.

5 Ferner sind noch als Schottky-Quellen bezeichnete Elektronenstrahlquellen bekannt, welche eine Erniedrigung der Potentialbarriere durch den Schottky-Effekt ausnutzen. Bei einer solchen Quelle ist typischerweise das elektrische Extraktionsfeld etwa zehn mal kleiner als bei 10 einer Feldemissionsquelle, so dass keine ausreichende Verschmälerung der Potentialbarriere zur nennenswerten Förderung eines Tunneleffekts auftritt. Eine solche Quelle wird zusätzlich geheizt, allerdings auf eine Temperatur, die niedriger ist, als bei einer vergleichbaren 15 thermischen Emissionsquelle. Die Temperatur ist jedoch ausreichend hoch, so dass die Elektronen durch thermische Anregung die durch den Schottky-Effekt abgesenkte Potentialbarriere überwinden können.

20 Im Hinblick auf eine geringe Energiebreite (FWHM) der Quelle sollte die Quelloberfläche eine niedrige Temperatur aufweisen, um eine thermische Verbreiterung der Energiebreite möglichst gering zu halten. Unter diesem Gesichtspunkt wären Feldemissionsquellen zu bevorzugen, 25 welche bei Raumtemperatur der Quelloberfläche betreibbar sind. Allerdings benötigen diese ein äußerst gutes Vakuum, um die Quelloberfläche nicht durch Ionenbombardierung zu zerstören. Ferner sind diese Quellen hinsichtlich der maximalen Strahlintensität limitiert.

30 Schottky-Quellen stellen hier typischerweise einen oft akzeptablen Kompromiss zwischen niedriger Temperatur der Quelloberfläche im Hinblick auf die Energieverbreiterung und Vermeidung eines äußerst guten Vakuums bereit. Aller-

dings sind diese Quellen, insbesondere dann, wenn sie bei niedriger Temperatur betrieben werden, im Hinblick auf die zeitliche Konstanz der Strahlintensität etwas nachteilhaft, da bereits sehr geringe Änderungen von 5 Umgebungsparametern, wie etwa Temperaturänderungen und Oberflächenkontaminationen und der gleichen, zu vergleichsweise großen Intensitätsschwankungen führen.

Ferner sind z.B. aus US 4,460,831 oder US 5,898,309 Elektronenstrahlquellen bekannt, bei denen die Quelloberfläche mit einem Photonenstrahl beleuchtet wird, um aus 10 der Oberfläche Elektronen unter Ausnutzung eines Photoeffekts auszulösen. Derartige Quellen werden dort eingesetzt, wo der Elektronenstrahl schnell an- und aus- 15 schaltbar sein soll, da schnell schaltbare Lichtquellen existieren, und die Elektronenstrahlintensität unmittelbar der geschalteten Lichtintensität folgt. Allerdings setzt eine solche Photoemissionsquelle bei üblichen Materialien der Quelloberfläche die Bestrahlung mit Licht 20 besonders kurzer Wellenlänge voraus, da die Energie der Lichtquanten größer sein muss als die Höhe der Potentialbarriere. Derartige Lichtquellen mit ausreichender Intensität sind allerdings aufwendig in der Beschaffung und im 25 Betrieb.

Aus US 5,041,724 ist eine schnell an- und ausschaltbare Photoemissionsquelle bekannt, bei der die Energie der für 30 die Photoemission notwendigen Photonen herabgesetzt bzw. die Wellenlänge des Lichts vergrößert ist, indem die Höhe der zu überwindenden Potentialbarriere erniedrigt ist durch ein zusätzliches starkes Extraktionsfeld, was zu einer sogenannten feldunterstützten Photoemission ("field assisted photo emission") führt, oder indem die Quelloberfläche zusätzlich geheizt wird, was zu einer

thermisch unterstützten Photoemission ("thermally assisted photo emission") führt.

Ferner ist es beispielsweise aus US 5,763,880 bekannt,  
5 die Potentialbarriere bzw. Austrittsarbeit eines Kathodenkörpers dadurch herabzusetzen, dass dessen Quelloberfläche mit einem Oxid oder Nitrid belegt wird.

Wie vorangehend bereits erläutert, weisen Quellen mit  
10 niedriger Temperatur aufgrund des höheren Beitrags eines Tunneleffekts zur Elektronenemission das Problem einer nicht optimal reproduzierbaren Strahlintensität auf.

Demgemäß ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,  
15 eine Elektronenstrahlquelle mit einer vergleichsweise niedrigen Temperatur der Quelloberfläche und gleichzeitig einer vergleichsweise guten Einstellbarkeit einer gewünschten Strahlintensität vorzuschlagen.

20 Ferner ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen elektronenmikroskopischen Apparat, insbesondere ein Elektronenmikroskop, vorzuschlagen, welcher einen Elektronenstrahl mit vergleichsweise geringer Energiebreite und vergleichsweise guter Einstellbarkeit des Strahlstromes ermöglicht.  
25

Die Erfindung sieht hierzu eine Elektronenstrahlquelle zur Erzeugung eines Strahls von Elektronen vor, welcher einen Kathodenkörper mit einer Quelloberfläche zur Emission von Elektronen und einer mit Abstand von dem Kathodenkörper angeordneten Anode zur Bereitstellung eines Extraktionsfeldes umfasst. Das Extraktionsfeld ist vorgesehen, um die Elektronen im Hinblick auf die Überwindung der Potentialbarriere zu unterstützen, also um die Poten-

tialbarriere durch die Feldwirkung wenigstens etwas abzusenken, wie dies vorangehend im Zusammenhang mit dem Schottky-Effekt beschrieben wurde, bzw. um die Potentialbarriere zu verschmälern, so dass gegebenenfalls auch ein 5 Tunnelprozess bei der Emission der Elektronen eine gewisse Rolle spielen kann, wie dies vorangehend im Zusammenhang mit dem Feldemissionsprozess beschrieben wurde.

Die Elektronenstrahlquelle umfasst ferner eine Photonenquelle 10 zur Erzeugung wenigstens eines auf die Quelloberfläche gerichteten Photonenstrahls, um die Emission der Elektronen durch einen Photoemissionsprozess ebenfalls zu unterstützen, wie dies vorangehend im Zusammenhang mit dem Photoeffekt beschrieben wurde. Somit wirken wenigstens 15 das Extraktionsfeld und der Photonenstrahl zusammen, um die Elektronen aus der Quelloberfläche auszulösen. Selbst wenn sich die Quelloberfläche aufgrund der Bestrahlung mit dem Photonenstrahl aufgrund von Energie-deposition über Raumtemperatur erwärmt und somit auch die 20 auf den Photonenstrahl zurückzuführende Erwärmung der Oberfläche einen thermischen Beitrag zu dem Emissionsprozess leistet, so ist dieser Beitrag vergleichsweise gering. Eine maximale Intensität des Photonenstrahls in einem Normalbetriebsmodus der Elektronenstrahlquelle ist 25 derart beschränkt, dass sich die Quelloberfläche, ausgehend von Raumtemperatur, nicht über eine Temperatur von 1700 K, insbesondere nicht über 1200 K und weiter bevorzugt nicht über 700 K erhöhen würde, wenn auf die Quelloberfläche alleine der Photonenstrahl fallen würde, und dem Kathodenkörper sonst aktiv keine weitere Energie, 30 beispielsweise durch eine zusätzlich Heizung oder dergleichen, zugeführt werden würde.

Der Photonenstrahl spielt allerdings erfindungsgemäß eine große Rolle im Hinblick auf die Einstellung der Intensität des emittierten Elektronenstrahls, da diese Elektronenstrahlintensität über eine Änderung der Intensität des Photonenstrahls eingestellt wird. Hierzu umfasst die Elektronenstrahlquelle weiter eine Messeinrichtung zur Erfassung eines Strahlstroms des Elektronenstrahls und zur Ausgabe eines den Strahlstrom repräsentierenden Messsignals sowie weiter eine Steuerung, die das Messsignal erfasst und auf die Photonenquelle im Normalbetriebsmodus der Elektronenstrahlquelle einwirkt, um die Intensität des Photonenstrahls in Abhängigkeit von dem Messsignal zu ändern.

Damit wird die einzustellende Größe, nämlich die Intensität des Elektronenstrahls selbst, als Messgröße verwendet, um auf den Photonenstrahl als Stellgröße einzuwirken, und zwar dahingehend, um die Elektronenstrahlintensität in einer gewünschten Weise zu steuern. Die Steuerung kann unter anderem im Hinblick auf eine zeitliche Konstanz der Elektronenstrahlintensität erfolgen, sie kann allerdings unter anderem auch im Hinblick auf einen gewünschten integralen Strahlstrom, d.h. eine abgegebene Ladung der Elektronenstrahlquelle, erfolgen. Somit ist es möglich, Schwankungen der Elektronenstrahlquelle, welche dann auftreten würden, wenn die Intensität des Photonenstrahls nicht in Abhängigkeit von der Elektronenstrahlintensität gesteuert werden würde, auszugleichen bzw. zu kompensieren. Derartige Schwankungen können beispielsweise auf kleine Schwankungen der Temperatur der Quelloberfläche oder von Oberflächenkontaminationen zurückzuführen sein, deren Auswirkungen dann besonders hoch sind, wenn die Temperatur der Quelloberfläche im Normalbetrieb besonders niedrig ist.

Im Hinblick auf eine geringere Intensität des Photonenstrahls und eine geringere Energie der Lichtquanten des Photonenstrahls bzw. eine größere Wellenlänge derselben,

5 ist vorzugsweise eine Heizeinrichtung vorgesehen, um den Kathodenkörper zu heizen, so dass auch eine thermische Anregung der Elektronen zur Emission derselben aus der Quelloberfläche beiträgt.

10 Hierbei ist es möglich, die Elektronenstrahlquelle dem Typ der herkömmlichen Schottky-Quelle derart anzunähern, dass der thermische Emissionsprozess einen maßgeblichen Anteil an der Elektronenemission aufweist und die Elektronenstrahlquelle einen wesentlichen

15 Elektronenstrahl, das heißt einen von einem Dunkelstrom abweichenden Elektronenstrahl, auch dann emittiert, wenn die Photonenquelle abgeschaltet ist. Es kann dann ein großer Teil der zur Emission der Elektronen notwendigen Energie durch eine im Vergleich zu einer Photonenquelle

20 einfache Heizeinrichtung bereitgestellt werden und die Photonenquelle hauptsächlich im Hinblick auf die gewünschte Einstellung, insbesondere Konstanthaltung, der Intensität des Elektronenstrahls verwendet werden.

25 Hierbei ist es bevorzugt, das Material der Quelloberfläche, das Extraktionsfeld, das Heizen des Kathodenkörpers und die Intensität des Photonenstrahls in dem Normalbetrieb der Elektronenstrahlquelle derart aufeinander abzustimmen, dass der Strahlstrom des Elektronenstrahls bei abgeschalteter Photonenquelle mehr als 30 %, insbesondere mehr als 65 % und weiter bevorzugt mehr als 30 % des Strahlstroms im Normalbetrieb der Elektronenstrahlquelle mit eingeschalteter Photonenquelle beträgt.

Die Heizeinrichtung kann vorzugsweise eine elektrische Heizeinrichtung umfassen, so dass die Erwärmung des Kathodenkörpers durch einen Ohm'schen Widerstand erfolgt.

5 Die Elektronenstrahlintensität kann durch die Mess-  
einrichtung besonders einfach dadurch erfasst werden,  
dass die Intensität von auf eine Strahlblende treffenden  
Elektronen erfasst wird, also ein von dieser Strahlblende  
10 abfließender Strom gemessen wird. Die Strahlblende kann  
insbesondere die Anode zur Bereitstellung des Extraktionsfeldes sein.

Die Quelloberfläche des Kathodenkörpers umfasst bevorzugterweise Bariumoxid und ist weiter bevorzugt im wesentlichen durch Bariumoxid bereitgestellt, da dieses Material eine besonders niedrige Austrittsarbeit aufweist. Das Bariumoxid ist vorzugsweise auf einem Kathodenkörper aus beispielsweise Wolfram aufgebracht.

20 Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ist auch vorgesehen, den Photonenstrahl neben seiner Funktion zur Einstellung der Elektronenstrahlintensität im Normalbetrieb noch für einen weiteren Zweck einzusetzen, nämlich zum Ausheizen der Quelloberfläche und des die Quelloberfläche  
25 bereitstellenden Teils des Kathodenkörpers. Im Normalbetrieb können nämlich Änderungen an einer Soll-Konfiguration der Quelloberfläche auftreten, wie beispielsweise Abscheidung von Ionen aus dem Restgas einer Vakuumkammer, in der die Elektronenstrahlquelle betrieben wird. Derartige Veränderungen können durch Ausheizen der Quelloberfläche wieder rückgängig gemacht werden, indem in einem vom Normalbetrieb der Quelle abweichenden Ausheizbetriebsmodus die Intensität des Photonenstrahls derart erhöht wird, dass die Temperatur der Quelloberfläche die

Arbeitstemperatur derselben im Normalbetrieb um mehr als 100 K, insbesondere um mehr als 200 K und weiter bevorzugt um mehr als 300 K oder mehr als 500 K übersteigt.

5 Die Erfindung sieht ferner den Einsatz der Elektronenstrahlquelle in einem elektronenoptischen Apparat vor. Der elektronenoptische Apparat umfasst insbesondere ein Elektronenmikroskop oder/und einen Elektronenlithographieapparat.

10

Ausführungsformen der Erfindung werden nachfolgend anhand von Zeichnungen näher erläutert. Hierbei zeigt:

15 Figur 1 eine Elektronenstrahlquelle gemäß einer Ausführungsform der Erfindung und

20 Figur 2 eine Elektronenstrahlquelle gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung, welche in einem erfindungsgemäßen elektronenoptischen Apparat angeordnet ist.

25 Eine in Figur 1 gezeigte Elektronenstrahlquelle 1 dient zur Bereitstellung eines Elektronenstrahls 3 einer vorbestimmten kinetischen Energie. Hierzu umfasst die Elektronenstrahlquelle 1 einen thermisch geheizten Kathodenkörper 5, welcher an einem V-förmig geformten Heizdraht 7 an der Spitze des V angebracht ist. Der Heizdraht 7 wird von einem Heizstrom durchflossen, welcher von einer Stromquelle 9 bereitgestellt wird. Der Kathodenkörper 5 ist an einem Ende zu einer Spitze ausgeformt, welche in Richtung des emittierten Elektronenstrahls 3 orientiert ist. Die Spitze des Kathodenkörpers 5 weist vor ihrem langgezogenen Ende einen Durchmesser von etwa 1  $\mu\text{m}$  auf und stellt die eigentliche Quelloberfläche des Kathoden-

körpers 5 bereit, d.h. die Oberfläche, von der die den Strahl 3 bildenden Elektronen austreten. Die Spitze des Kathodenkörpers kann auch an einem langgestreckten Drahtstück eines Durchmessers von 5 mm oder weniger, 5 insbesondere 3 mm oder weniger oder gar 1 mm oder weniger vorgesehen sein.

Der Kathodenkörper 5 ist aus Wolfram gefertigt, und seine Oberfläche und insbesondere die Quelloberfläche sind mit 10 einer Schicht aus Bariumoxid versehen, so dass die Quelloberfläche eine wesentlich kleine Austrittsarbeit als Wolfram selbst und, je nach Präparationszustand, von etwa 1,5 eV bis 2,0 eV aufweist. Die Beschichtung der Quelloberfläche mit Bariumoxid kann nach einem ähnlichen 15 Verfahren erfolgen, wie dies in US 5,763,880 für andere Materialien beschrieben ist.

Allerdings ist Bariumoxid in der Umgebungsluft nicht vollständig stabil, so dass die Präparation der 20 Quelloberfläche vorzugsweise im Vakuum erfolgt. Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass auf dem Wolframkörper 5 ein Barium-Reservoir, beispielsweise in Form eines um den Körper gewickelten Bariumdrahtes, aufgebracht wird, der Wolframkörper 5 sodann durch Stromfluss 25 erhitzt wird und in das Vakuumvolumen sodann Sauerstoff zugeführt wird, so dass das Barium oxidiert und das Oxid sich auf der Oberfläche des Körpers ausbreitet.

Es ist möglich, die Quelloberfläche separat von der Elektronenstrahlquelle 1 zu fertigen und den Kathodenkörper 30 dann in einem Vakuumgefäß zu der Quelle zu transportieren und die Quelle durch eine Vakumschleuse der Quelle in diese einzuführen. Es ist jedoch auch möglich, den Kathodenkörper an Ort und Stelle in der Elektronenstrahl-

quelle zu präparieren, indem der mit dem Barium-Reservoir versehene Kathodenkörper in der Quelle montiert wird und das Erhitzen des Kathodenkörpers in dem Vakuum der Quelle selbst erfolgt, wobei Sauerstoff durch eine in Figur 1 5 nicht dargestellte Zuleitung in die Nähe des Kathodenkörpers transportiert wird. Im Normalbetrieb wird die Quelle bei einem Vakuum einer Größenordnung von etwa  $10^{-8}$  mbar betrieben.

10 Mit Abstand von der Quelloberfläche ist eine Anodenblende 11 angeordnet, um zwischen der Quelloberfläche und der Anodenblende 11 ein elektrisches Extraktionsfeld durch eine Hochspannungsquelle 13 bereitzustellen. Die Anodenblende 11 weist eine Öffnung 12 für den Durchtritt 15 des Elektronenstrahls 3 auf, und der Kathodenkörper 5 und der Heizdraht 7 sind von einer sogenannten Supressorelektrode 15 umgeben, welche durch eine in Figur 1 nicht gezeigte Spannungsquelle auf ein geeignetes elektrisches Potential gebracht wird, um zwischen der Kathodenspitze 20 mit der Quelloberfläche und der Anodenblende 11 das elektrische Extraktionsfeld so zu formen, dass die von der Quelloberfläche austretenden Elektronen durch die Öffnung 12 in der Anodenblende 11 geführt und dabei auch etwas fokussiert werden, um den Elektronenstrahl 3 zu formen. 25

Nach Durchlaufen der Anodenblende 11 durchsetzt der Elektronenstrahl 3 eine weitere Blendenelektrode 17 durch eine Ausnehmung 18 derselben. Die metallische Blenden- 30 elektrode 17 weist eine der Quelloberfläche zugewandte parabolförmige Oberfläche 19 auf, welche derart geformt und relativ zu der Spitze des Kathodenkörpers angeordnet ist, dass ein Abstand zwischen der Quelloberfläche und

dem Parabelboden zweimal so groß ist wie ein Krümmungsradius des Parabolspiegels am Ort des Parabelbodens.

5 Eine Hochspannungsquelle 23 ist vorgesehen, um auch die Anodenblende 17 gegenüber der Kathode 5 elektrisch derart vorzuspannen, dass die Elektronen nach Durchlaufen der Anode 11 hin zu der Elektronenblende 17 weiter beschleunigt werden.

10 Eine Photonenquelle 27 ist vorgesehen, um einen im wesentlichen parallel kollimierten Photonenstrahl 29 zu erzeugen, welcher auf den Parabolspiegel 19 gerichtet ist. Die Photonenquelle 27 umfasst eine Halbleiterlaserdiode 31, welche Licht einer Wellenlänge von 650 nm divergent emittiert. Das divergent emittierte Licht wird durch eine Kollimationsoptik 33 kollimiert, um den im wesentlichen parallel kollimierten Strahl 29 zu formen. Der Strahl 29 tritt durch ein in einem Vakuummantel 35 der Elektronenstrahlquelle 1 vorgesehenes Fenster 37 in den Vakuumraum der Elektronenstrahlquelle 1 ein. Durch den Parabolspiegel 19 wird der Strahl 29 durch die Öffnung 12 der Anode 11 hindurch auf die Spitze des Kathodenkörpers 5 und damit auf die Quelloberfläche fokussiert, so dass die auf die Quelloberfläche treffenden 20 25 30 Photonen eine Emission der Elektronen von der Quelloberfläche durch einen Photoeffektmechanismus unterstützen.

Eine Intensität des Photonenstrahls 29 ist einstellbar, indem eine Steuerung 39 eine der Laserdiode 31 zugeführte elektrische Leistung einstellt.

Ein Strommessgerät 41 ist in eine Verbindungsleitung 43 zwischen der Hochspannungsquelle 23 und der Blendenelektrode 17 eingefügt. Damit misst das Strommessgerät 41

einen zwischen dem Kathodenkörper 5 und der Blendenelektrode 17 fließenden Strom. Dieser ist bestimmt durch die Menge an Elektronen, welche pro Zeiteinheit von der Quelloberfläche emittiert werden und die Elektrodenblende 17 treffen, das heißt diese nicht durch deren Öffnung 18 durchsetzen. Damit repräsentiert das von dem Strommessgerät 41 bereitgestellte Messsignal die Intensität des Elektronenstrahls 3 nach Durchsetzen der Blendenelektrode 17 durch deren Öffnung 18.

10

Das Messsignal des Strommessgerätes 41 wird der Steuerung 39 zugeführt. Diese steuert dann die Laserdiode 31 der Photonenquelle 27 derart an, dass das Messsignal des Strommessgeräts 41 und damit auch die Intensität des Elektronenstrahls 3 in einem Normalbetrieb der Elektronenstrahlquelle 1 konstant gehalten wird.

Durch die Widerstandsheizung, d.h. den Stromfluss durch den Heizleiter 7, wird der Kathodenkörper und damit die Quelloberfläche auf eine Temperatur von etwa 1000 K geheizt. Dies ist eine Temperatur, bei der auch bei abgeschaltetem Photonenstrahl 29 bereits Elektronen aus der Quelloberfläche austreten und einen Elektronenstrahl formen. Dieser Strahl weist dann allerdings eine Intensität bzw. einen Strahlstrom auf, welcher nur etwa 80 % des Strahlstroms der Elektronenstrahlquelle 1 im Normalbetrieb, das heißt bei eingeschaltetem Photonenstrahl 29, beträgt.

30 Die Hochspannungsquelle 13 stellt eine Spannung von etwa 5 kV zwischen dem Kathodenkörper 5 und der Anodenblende 11 bereit, so dass das elektrische Extraktionsfeld an der Quelloberfläche eine Stärke von etwa  $10^6$  V/cm aufweist.

Bei ausgeschaltetem Photonenstrahl 29 wirken die thermische Heizung des Kathodenkörpers und das Extraktionsfeld zusammen, um Elektronen aus der Quelloberfläche auszulösen, wie dies vorangehend in Zusammenhang mit dem

5 Schottky-Effekt beschrieben wurde. Aufgrund der Beteiligung eines Tunneleffekts hieran ist die Elektronenstrahlintensität sehr stark abhängig von der Temperatur der Quelloberfläche, und geringste Schwankungen von Betriebszuständen der Elektronenstrahlquelle 1 können damit

10 zu beträchtlichen Schwankungen der Stromstärke des Elektronenstrahls 3 führen. Derartige Schwankungen des Strahlstroms werden allerdings durch das Messgerät 41 erfasst und an die Steuerung 39 übermittelt, welche wiederum die Photonenquelle 27 im Hinblick auf eine Änderung der Intensität des Photonenstrahls 29 ansteuert, um Änderungen der Elektronenstrahlintensität über den

15 Photoeffekt entgegenzuwirken. Der Elektronenstrahl 3 ist somit durch den Photonenstrahl 29 hinsichtlich seiner Strahlintensität stabilisiert. Gleichzeitig ist die

20 Temperatur von 1000 K der Quelloberfläche im Vergleich zu herkömmlichen Schottky-Emittern relativ gering, was eine geringe Breite (FWHM) der Verteilung der kinetischen Energien der Elektronen in dem Elektronenstrahl 3 zur Folge hat. Die Energiebreite beträgt etwa 0,3 eV.

25 Somit stellt die Elektronenstrahlquelle 1 einen Elektronenstrahl 3 mit geringer Energiebreite und guter zeitlicher Konstanz bereit.

30 Die Photonenquelle 27 ist ferner derart ausgelegt, dass die Intensität des Photonenstrahls 29 in einem Ausheizbetrieb der Elektronenstrahlquelle 1 erhöht werden kann im Vergleich zur Intensität des Strahls 29 im Normalbetrieb der Elektronenstrahlquelle 1. Die Intensität des

Photonenstrahls 29 kann dabei soweit erhöht werden, dass die Temperatur der Quelloberfläche durch die erhöhte Photonenintensität auf etwa 1300 K oder bis zu 1500 K im Vergleich zu etwa 1000 K im Normalbetrieb erhöht ist.

5 Hierdurch ist es möglich, innerhalb einer kurzen Zeit von etwa 1 ms oder kürzer auf der Quelloberfläche abgelagerte Kontaminationen zu entfernen.

10 Nachfolgend werden Varianten der anhand der Figur 1 erläuterten Ausführungsform beschrieben. Hierin sind Komponenten, die Komponenten der Figur 1 hinsichtlich ihres Aufbaus und ihrer Funktion entsprechen, mit den Bezugsziffern der Figur 1 versehen, denen zur Unterscheidung jedoch ein zusätzlicher Buchstabe hinzugefügt ist. Es 15 wird auf die gesamte vorangehende Beschreibung Bezug genommen.

20 In Figur 2 ist ein Elektronenmikroskop 51 schematisch dargestellt. Dieses umfasst eine Elektronenquelle 1a zur Erzeugung eines Elektronenstrahls 3a, welcher von einer Objektivlinse 53 in einer Objektebene 55 fokussiert wird. Von einem Objekt in der Objektebene 55 durch den fokussierten Elektronenstrahl 3a ausgelöste Sekundärelektronen durchsetzen die Objektivlinse 53 und treffen auf einen 25 Elektronendetektor 57, um dort nachgewiesen zu werden. In einer Öffnung der Objektivlinse 53 sind Ablenkspulen 59 angeordnet, um einen Ort, an dem der Elektronenstrahl 3a in der Objektebene 55 fokussiert ist, in der Objektebene 55 zu verlagern. Eine Aufzeichnung der durch den Detektor 30 57 registrierten Sekundärelektronenintensität in Abhängigkeit von dem Fokusort des Strahls 3a in der Objektebene 55 liefert dann ein elektronenmikroskopisches Bild der Objektebene 55.

Die Elektronenquelle 1a weist einen ähnlichen Aufbau auf, wie die in Figur 1 gezeigte Elektronenquelle. So wird auch bei der Elektronenquelle 1a ein Kathodenkörper 5a, der innerhalb einer Suppressorelektrode 15a angeordnet 5 ist, durch eine in Figur 2 nicht dargestellte Heizeinrichtung geheizt. Mit Abstand von dem Kathodenkörper 5a ist eine Anodenblende 17a mit einer zentralen Öffnung 18a angeordnet, welche von dem Elektronenstrahl 3a durchsetzt wird.

10

Im Unterschied zu der Blende 17 gemäß Figur 1 ist hier die Anodenblende 17a allerdings nicht mit einer parabolischen Spiegelfläche versehen. Vielmehr weist die Anodenblende 17a mehrere plane Spiegelflächen 61 auf, auf 15 welche jeweils ein Laserstrahl 29a gerichtet ist, die jeweils durch Fenster 37a in einem Vakuummantel 35a des Elektronenmikroskops 51 eintreten.

Die Laserstrahlen 29a sind derart fokussiert, dass sie 20 nach Reflexion an den Spiegelflächen 61 auf der Spitze des Kathodenkörpers 5a fokussiert sind. Die mehreren Strahlen 29a, welche von beispielsweise zwei, vier oder mehr in Umfangrichtung um den Elektronenstrahl 3a verteilt angeordneten Quellen 27a emittiert werden, treffen 25 hierbei derart auf die im Hinblick auf Elektronenemission aktive Quelloberfläche, dass mehr als 60 % derselben, insbesondere mehr als 80 % derselben oder diese im wesentlichen vollständig beleuchtet wird.

30 Auch bei dieser Ausführungsform sind ein Messgerät zur Messung des Elektronenstrahls 3a über dem auf die Anodenblende 17a treffenden Strom, eine Steuerung 39a und einstellbare Lichtquellen für die Strahlen 29a vorgesehen, um die Intensität der Laserstrahlen 29a in Abhängigkeit

von dem Elektronenstrahlstrom anzusteuern, und zwar im Hinblick darauf, die Intensität des Elektronenstroms 3a konstant zu halten.

5 Auch bei dem Elektronenmikroskop 51 emittiert die Elektronenstrahlquelle 1a in einem von dem Normalbetrieb abweichenden Betriebsmodus, in dem die Laserstrahlen 29a ausgeschaltet sind, eine Elektronenstrahlintensität, die etwa 80 % der Intensität des Elektronenstrahls 3a im  
10 Normalbetrieb beträgt.

In der Ausführungsform der Figur 1 sind eine Anodenblende 11 und eine weitere Anodenblende 17 im Strahlengang des Elektronenstrahls hintereinander vorgesehen. Die im  
15 Strahlengang erster Anodenblende 11 wird auch häufig als Extraktor bezeichnet. Es ist bei dieser Ausführungsform jedoch auch möglich, lediglich eine Anodenblende vorzusehen, wenn dies für die Formung des Strahls ausreicht. Alternativ zu der in Figur 1 gezeigten  
20 Ausführungsform, kann auch der auf die erste Anodenblende 11 treffende Strahlstrom gemessen und von der Steuerung 39 erfaßt werden, um die Photonenstrahlintensität entsprechend anzusteuern bzw. zu regeln.

25 Auch in der Figur 2 ist es möglich, eine weitere Anodenblende bzw. ein Extraktor, zwischen der Anode 17a und dem Kathodenkörper 5a vorzusehen. Hierbei ist es möglich, die Aperturöffnung einer solchen weiteren Anodenblende so groß zu wählen, daß sie auch von den  
30 Photonenstrahlen 29a durchsetzt wird. Es ist ebenfalls möglich, eine zentrale kleine Aperturöffnung für den Durchtritt des Elektronenstrahls 3 auch vorzusehen und hiervon separate weitere Ausnehmungen für den Durchtritt der Lichtstrahlen 29a vorzusehen.

Neben der Messung des Strahlstroms über die Messung eines auf eine Anodenblende treffenden Elektronenstroms ist es auch möglich, an einer anderen Stelle der Anordnung den 5 Strahlstrom zu messen, beispielsweise über die Messung eines Stroms, den der Elektronenstrahl auf eine zu untersuchende Probe transportiert, d.h. es wird dann der von der Probe abfließende Strom gemessen.

10 Eine Abwandlung des in Figur 2 gezeigten Elektronenmikroskops erlaubt es, diese Apparatur als ein Lithographiegerät zu betreiben. Es wird dann die Heizung des Kathodenkörpers nur vermindert betrieben bzw. gar nicht bereitgestellt. Die Photonenstrahlen 29a und das durch 15 die Anodenblende 17a erzeugte Extraktionsfeld wirken alleine zusammen, um die Elektronen zur Bildung des Strahls 3a aus der Quelloberfläche auszulösen. Somit wird bei abgeschaltetem Laserstrahl 29a kein Elektronenstrahl 3a emittiert. Es ist dann möglich, durch Auslenken des Elektronenstrahls 3a durch die Ablenkspulen 59 und Ein- und Ausschalten des Elektronenstrahls 3a über Ein- und Ausschalten der Laserstrahlen 29a ein Muster auf eine strahlungsempfindliche Schicht ("resist") zu schreiben, welche in der Objektebene 55 angeordnet ist.

25 Hierbei ist es häufig gewünscht, das Muster mit "Graustufen" zu schreiben, d.h. nicht nur binäre Muster durch Ein- und Ausschalten Strahls zu erzeugen sondern Übergänge zwischen einer voll belichteten und einer gar nicht 30 belichteten strahlungsempfindlichen Schicht zu erzeugen. Hierfür ist es wesentlich, eine durch den Elektronenstrahl 3a an einem durch die Auslenkung mittels der Ablenkspulen 59 vorgegebenen Ort genau in Abhängigkeit von einer Empfindlichkeitskennlinie der strahlungsempfind-

lichen Schicht einzustellen. Dies bedeutet, in einem jeden Ort soll es möglich sein, eine vorbestimmte Menge an Elektronen, d.h. eine vorbestimmte Ladung, zu deponieren. Es ist hierzu vorgesehen, dass die Steuerung 39a den auf 5 die Anodenblende 17a treffenden Elektronenstrom integriert und bei Erreichen eines Schwellenwerts des Integrals die Laserlichtquellen 27a ausschaltet. Diese Prozedur wird für einen jeden Ort bzw. Pixel in der Objekt ebene 5 wiederholt.

10

In den vorangehend beschriebenen Ausführungsformen trifft der Photonenstrahl jeweils von der Seite der Anodenblende auf die Quelloberfläche. Es ist jedoch auch möglich, den Elektronenstrahl von einer entgegengesetzte Seite auf die 15 Quelloberfläche zu richten, wie dies beispielsweise in US 5,808,309 oder US 6,376,985 B2 offenbart ist.

Ferner ist die Quelloberfläche in den vorangehend beschriebenen Ausführungsformen durch Bariumoxid bereitgestellt, welches auf eine Wolframspitze aufgetragen ist. Alternativ hierzu ist es möglich, Oxide oder Nitride der Elemente Yttrium, Scandium, Vanadium, Lanthan, Zirkon, Titan oder Mischungen derselben auf geeignete Kathodenkörper aufzutragen.

25

In den vorangehend beschriebenen Ausführungsformen wird die Intensität des Photonenstrahls durch Ändern einer der Laserquelle zugeführten elektrischen Intensität eingestellt. Es ist jedoch auch möglich, die Intensität des 30 Photonenstrahls durch andere Maßnahmen zu ändern, beispielsweise durch das Einfügen einer durch die Steuerung ansteuerbaren Pockels-Zelle mit Polarisator oder einen Niedervoltmodulator in den Strahlengang.

Zusammenfassend wird eine Elektronenstrahlquelle 1 vorgeschlagen, deren Quelloberfläche mittels eines Photonenstrahls beleuchtet wird, dessen Intensität variabel ist. Der Photonenstrahl unterstützt die Emission der

5 Elektronen von der Quelloberfläche durch einen Photoeffekt. Ergänzend hierzu wird noch ein Extraktionsfeld bereitgestellt, um Elektronen aus der Quelloberfläche auszulösen. Gegebenenfalls kann auch noch eine Heizeinrichtung vorgesehen sein, um die Emission der

10 Elektronen aus der Quelloberfläche thermisch zu unterstützen. Ein Elektronenstrahlstrom wird gemessen, und die Intensität der Photonenquelle wird in Abhängigkeit von dem gemessenen Elektronenstrahlstrom eingestellt.

LEO Elektronenmikroskopie GmbH

Leo Elektronenmikroskopie GmbH  
Z8966-DE FS/HQ

5

### Patentansprüche

1. Elektronenstrahlquelle zur Erzeugung eines Strahls  
(3) von Elektronen, umfassend:

10

- einen Kathodenkörper (5) mit einer Quelloberfläche zur Emission von Elektronen,
- eine mit Abstand von dem Kathodenkörper angeordnete Anode (11, 17a) zur Bereitstellung eines Extraktionsfeldes, um die Emission der Elektronen durch einen Feldemissionsprozess zu unterstützen,
- eine Photonenquelle (27), zur Erzeugung wenigstens eines auf die Quelloberfläche gerichteten Photonenstrahls (29), um die Emission der Elektronen durch einen Photoemissionsprozess ebenfalls zu unterstützen, wobei die Photonenquelle (27) derart ausgebildet ist, dass eine Intensität des Photonenstrahls änderbar ist,
- eine Messeinrichtung (41) zur Erfassung eines Strahlstroms des Elektronenstrahls (3) und zur Ausgabe eines den Strahlstrom repräsentierenden Messsignals,
- eine Steuerung (39), um die Photonenquelle (27) in einem Normalbetriebsmodus der Elektronenstrahlquelle (1) in Abhängigkeit von dem Messsignal zur Änderung der Intensität des Photonenstrahls anzusteuern.

wobei eine maximale Intensität des Photonenstrahls (29) in dem Normalbetriebsmodus derart beschränkt ist, dass sich die Quelloberfläche in einem von dem Normalbetriebsmodus verschiedenen Betriebsmodus, in dem dem Kathodenkörper (5) neben dem Photonenstrahl (29) mit der maximalen Intensität in dem Normalbetriebsmodus keine weitere Energie zugeführt wird, nicht über eine Temperatur von 1300 K erhitzt, insbesondere nicht über 900 K und weiter bevorzugt nicht über 600 K erhitzt.

5

10

2. Elektronenstrahlquelle nach Anspruch 1, ferner umfassend eine Heizeinrichtung (7) zum Heizen des Kathodenkörpers (5), um diesem weiter Energie zuzuführen und die Emission der Elektronen durch einen thermischen Emissionsprozess ebenfalls zu unterstützen.

15

3. Elektronenstrahlquelle nach Anspruch 2, wobei die Elektronenstrahlquelle einen wesentlichen Elektronenstrahl (3) auch dann emittiert, wenn die Photonenquelle (27) abgeschaltet ist.

20

4. Elektronenstrahlquelle nach Anspruch 3, wobei ein die Quelloberfläche des Kathodenkörpers (5) bereitstellendes Material, das Extraktionsfeld, das Heizen des Kathodenkörpers (5) und die Intensität des Photonenstrahls (29) in dem Normalbetrieb derart aufeinander abgestimmt sind, dass ein Strahlstrom des Elektronenstrahls (3) bei abgeschalteter Photonenquelle (27) mehr als 30 %, insbesondere mehr als 65 % und weiter bevorzugt mehr als 80 %, des Strahlstroms im Normalbetrieb mit eingeschalteter Photonenquelle (27) beträgt.

25

30

5. Elektronenstrahlquelle nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei die Heizeinrichtung (7) eine elektrische Widerstandsheizung umfasst.

5

6. Elektronenstrahlquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Steuerung (39) die Photonenquelle (27) derart ansteuert, dass der Strahlstrom im Normalbetrieb im wesentlichen konstant ist.

10

7. Elektronenstrahlquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei in einem Strahlengang des Photonenstrahls (29) zwischen der Photonenquelle (27) und der Quelloberfläche ein den Photonenstrahl (29) umlenkender Spiegel (19) vorgesehen ist.

15

8. Elektronenstrahlquelle nach Anspruch 7, wobei der Spiegel (19) an einer Aperturblende (17) für den Elektronenstrahl (3) bereitgestellt ist.

20

9. Elektronenstrahlquelle nach Anspruch 7 oder 8, wobei der Spiegel ein Fokussierspiegel, insbesondere ein Spiegel (19) mit einer im wesentlichen parabolförmigen Spiegelfläche ist.

25

10. Elektronenstrahlquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei mehrere Photonenstrahlen (29a) auf die Quelloberfläche gerichtet sind.

30

11. Elektronenstrahlquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Messeinrichtung (41) eine Intensität von auf eine Strahlblende (11), insbesondere

die Anode (17a), treffenden emittierten Elektronen erfasst.

12. Elektronenstrahlquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei ein die Quelloberfläche des Kathodenkörpers (5) bereitstellendes Material Bariumoxid umfasst und wobei insbesondere die Quelloberfläche im wesentlichen aus Bariumoxid besteht.

10 13. Elektronenstrahlquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei in dem Normalbetrieb der Elektronenstrahlquelle die Quelloberfläche eine Arbeitstemperatur aufweist und die Photonenquelle dazu ausgebildet ist, in einem Ausheizbetriebsmodus die Intensität des Photonenstrahls derart zu erhöhen, dass eine Temperatur der Quelloberfläche die Arbeitstemperatur um mehr als 100°C, insbesondere mehr als 200°C und weiter bevorzugt um mehr als 300°C, übersteigt.

20 14. Elektronenoptischer Apparat, insbesondere Elektronenmikroskop, mit einer Elektronenstrahlquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 13.

25 15. Verfahren zum Betrieb einer Elektronenstrahlquelle, welche einen Kathodenkörper mit einer Quelloberfläche aufweist, und wobei das Verfahren umfasst: Beleuchten der Quelloberfläche mit einem Photonenstrahl änderbarer Intensität, Messen einer Intensität des erzeugten Elektronenstrahls, und Ändern der Intensität des Photonenstrahls in Abhängigkeit von der gemessenen Intensität des erzeugten Elektronenstrahls.

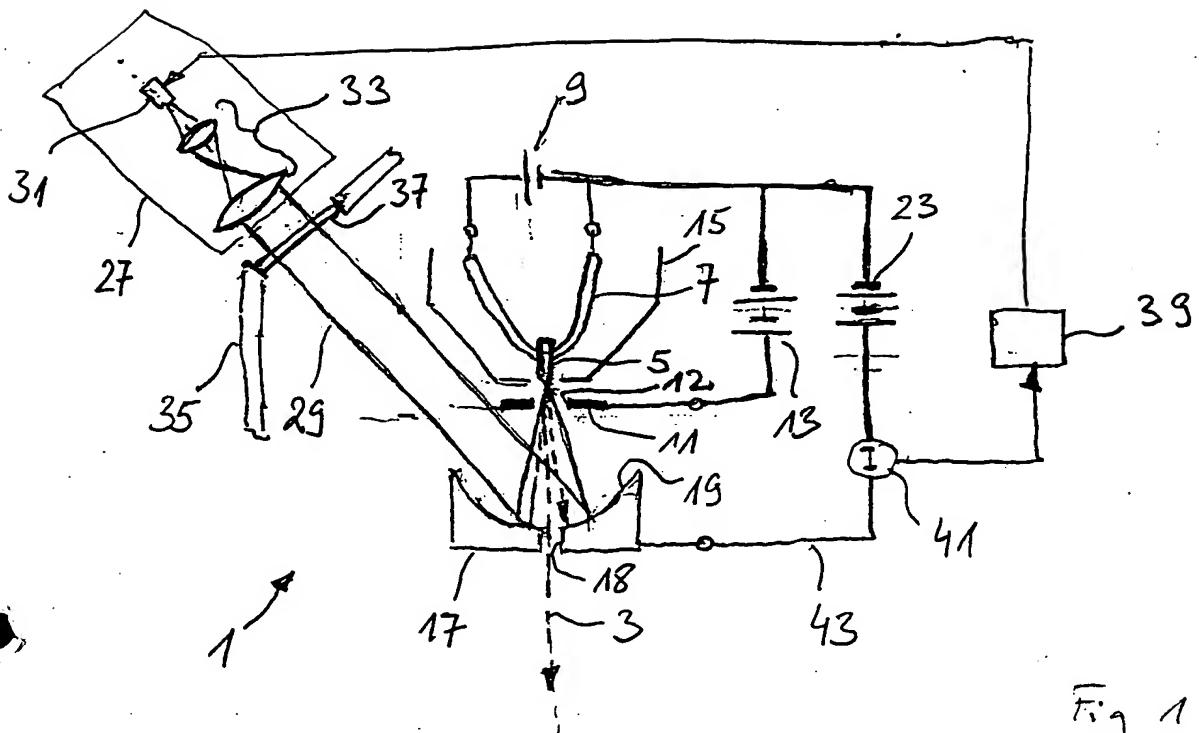


Fig 1

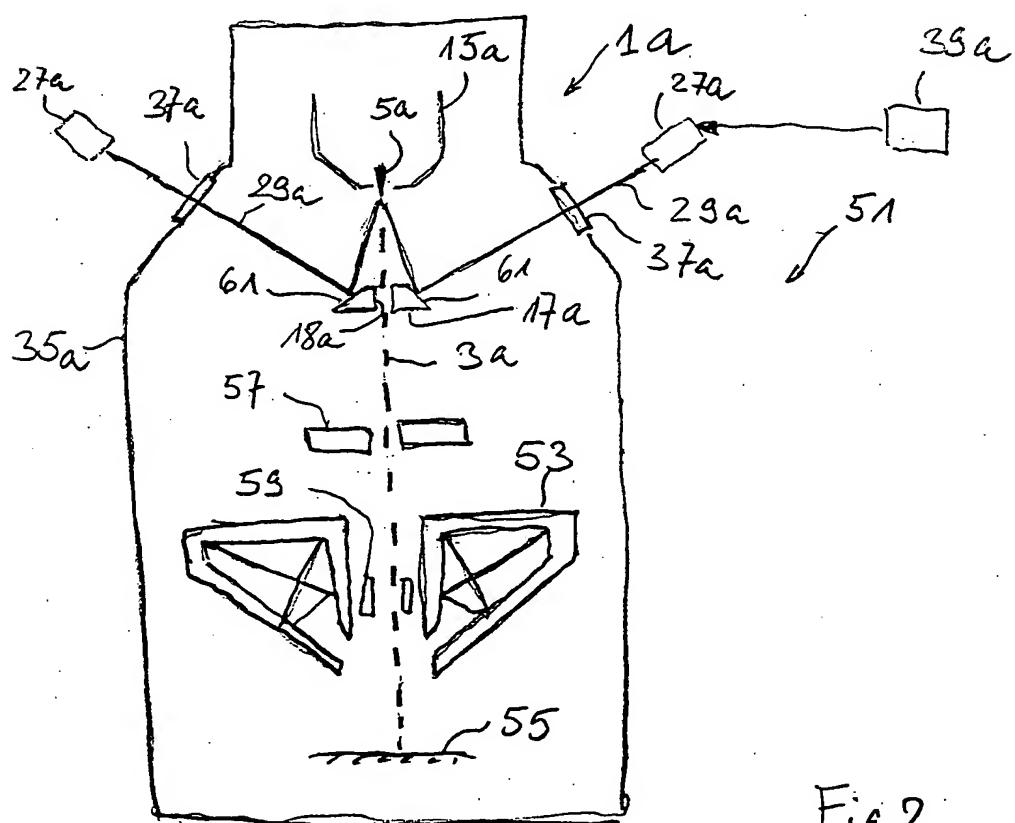


Fig 2

LEO Elektronenmikroskopie GmbH  
Z8966-DE FS/HQ

5

### **Zusammenfassung**

Es wird eine Elektronenstrahlquelle (1) vorgeschlagen, deren Quelloberfläche (5) mittels eines Photonenstrahls (29) beleuchtet wird, dessen Intensität variabel ist. Der 10 Photonenstrahl unterstützt die Emission der Elektronen von der Quelloberfläche durch einen Photoeffekt. Ergänzend hierzu wird noch ein Extraktionsfeld bereitgestellt, um Elektronen aus der Quelloberfläche auszulösen. Gegebenenfalls kann auch noch eine Heizeinrichtung (7) vorgeschen sein, um die Emission der Elektronen aus der 15 Quelloberfläche thermisch zu unterstützen. Ein Elektronenstrahlstrom (1) wird gemessen, und die Intensität der Photonenquelle (27) wird in Abhängigkeit von dem gemessenen Elektronenstrahlstrom eingestellt.

20

(Figur 1)

## Figur für die Veröffentlichung mit der Zusammenfassung

